

CONTENTS

<i>Amelichev V. V., Danilova N. L., Pankov V. V., Tarasov V. A. Design and Technology Basis for Multi-Versioned Production of Integrated Semiconductor Tensoresistive Transducers.</i>	2
<i>Zolotov Yu. N., Timoshenkov S. P., Shelepin N. A. Application of Complex Methods of Designing During the Development of Integrated Transducers of Mechanical Values</i>	4
<i>Amelichev V. V., Galushkov A. I., Reznev A. A., Saurov A. N., Sukhanov V. S. Visualization of Induced Non-Uniformities of Magnetic Field of Earth</i>	11
<i>Amelichev V. V., Pavlov A. Yu., Pogalov A. I., Chaplygin Yu. A. Optimization of Design of Physical Type Integrated Transducers</i>	14
<i>Dyagilev V. V., Mikhailov Yu. A., Ignat'eva E. V., Sheshukova S. Yu. Some Results of Development and Improvement of Silicon Integrated Strain Gage Microchips Manufacture.</i>	17
<i>Amelichev V. V., Galushkov A. I., Dyagilev V. V., Kasatkin S. I., Muravyev A. M., Lopatin V. V., Reznev A. A., Saurov A. N., Sukhanov V. S. Microelectronic Magneto-Resistive Processing.</i>	22
<i>Amelichev V. V., Verner V. D., Il'kov A. V. MEMS-Microphone. Choice of Materials, Designs and Technologies. Part II.</i>	27
<i>Konoplev B. G., Pristupchik N. K., Ryndin E. A. Three-Axis Autoemission Accelerometer</i>	36
<i>Roshchupkin D. V., Irzhak D. V. Investigations of Acoustic Wavefields in Piezoelectric Crystals Using Scanning Electron Microscopy and X-Ray Methods.</i>	40
<i>Glukhova O. E. Functional Nanodevices on the Basis of Nanocluster C₆₀@C₄₅₀.</i>	52
<i>Abramov I. I. Problems and Principles of Physics and Simulation of Micro- and Nanoelectronics Devices. Part V. Resonant-Tunneling Structures</i>	57
<i>Krutov V. V., Mikhalevich V. G., Shchuka A. A. Formation of Nanodomain Periodical Structures in Ferroelectrics Using Optical Interference</i>	71

For foreign subscribers:

Journal of "NANO and MICROSYSTEM TECHNIQUE" (Nano- i mikrosistemnaya tekhnika, ISSN 1813-8586)

The journal bought since november 1999.

Editor-in-Chief Ph. D. Petr P. Maltsev

ISSN 1813-8586.

Address is: 4, Stromynsky Lane, Moscow, 107076, Russia. Tel./Fax: +7(495) 269-5510.

E-mail: nmst@zknet.ru; <http://www.microsystems.ru>

Адрес редакции журнала: 107076, Москва, Стромьинский пер., 4/1. Телефон редакции журнала (495) 269-5510. E-mail: nmst@zknet.ru

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № 77-18289 от 06.09.04.

Дизайнер Т. Н. Погорелова. Технический редактор И. С. Павлова. Корректор Т. В. Арбузова

Сдано в набор 19.01.2007. Подписано в печать 21.02.2007. Формат 60×88 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 9,8. Уч.-изд. л. 11,83. Заказ 353. Цена договорная

Отпечатано в Подольской типографии — филиал ОАО "ЧПК", 142110, г. Подольск, ул. Кирова, 15